

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年7月24日(24.07.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/154409 A1

(51) 国際特許分類:
G01N 21/88 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/042149

(22) 国際出願日: 2024年11月28日(28.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2024-005776 2024年1月18日(18.01.2024) JP

(71) 出願人: 株式会社東京ウエルズ(TOKYO WELD CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1430021 東京都大田区北馬込2-28-1 (JP).

(72) 発明者: 菊地 大樹(KIKUCHI Taiki); 〒1430021 東京都大田区北馬込2-28-1 (JP). 横山 嘉彦(YOKOYAMA Yoshihiko); 〒1430021 東京都大田区北馬込2-28-1 (JP). 加藤 嗣(KATO Tsukasa); 〒1430021 東京都大田

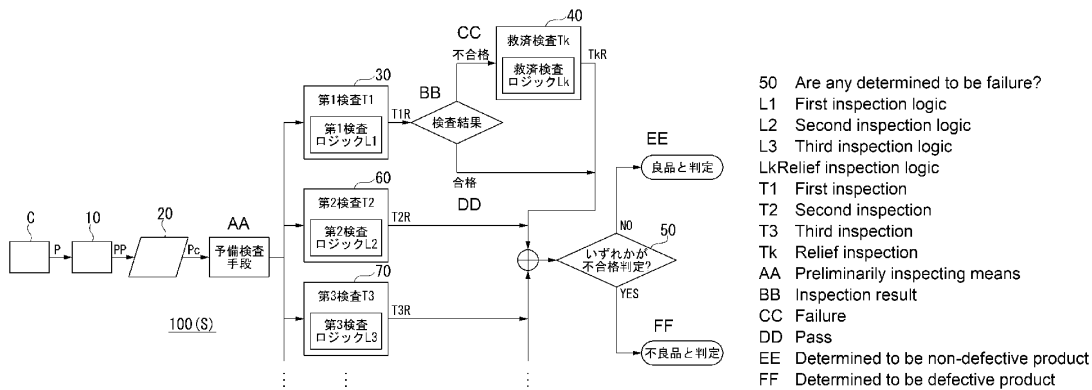
区北馬込2-28-1 (JP). 小宮 怜王名(KOMIYA Reona); 〒1430021 東京都大田区北馬込2-28-1 (JP).

(74) 代理人: 柳元 八大, 外(YANAGIMOTO Hachidai et al.); 〒1530063 東京都目黒区目黒1-5-4 テルレ301 (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) Title: IMAGE INSPECTION DEVICE FOR ELECTRONIC COMPONENT, IMAGE INSPECTION METHOD, AND IMAGE INSPECTION PROGRAM

(54) 発明の名称: 電子部品の画像検査装置、画像検査方法及び画像検査プログラム



(57) Abstract: This image inspection device 100 for an electronic component 1 comprises: a position detecting means 10 that detects a product position PP on the basis of a product image P; an image correcting means 20 that generates a corrected product image Pc obtained by correcting the product image P on the basis of the product position PP; a first inspecting means 30 that executes a first inspection T1 having a first inspection logic L1 on the basis of the corrected product image Pc and outputs a first inspection result T1R; a relief inspection means 40 that executes a relief inspection Tk having a relief inspection logic Lk different from the first inspection logic L1, when the first inspection result T1R satisfies a specific condition in the first inspection logic L1, and outputs a relief inspection result TkR; and a comprehensive determining means 50 that performs a comprehensive determination of the electronic component 1 on the basis of the first inspection result T1R and the relief inspection result TkR.

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

規則4. 17に規定する申立て:

— 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て (規則4. 17(v))

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 電子部品1の画像検査装置100は、製品画像Pに基づいて、製品位置PPを検出する位置検出手段10と、製品位置PPに基づいて製品画像Pを補正した補正製品画像Pcを生成する画像補正手段20と、補正製品画像Pcに基づいて第1検査ロジックL1を有する第1検査T1を実行して第1検査結果T1Rを出力する第1検査手段30と、第1検査結果T1Rが第1検査ロジックL1において特定条件となる場合に第1検査ロジックL1とは異なる救済検査ロジックLkを有する救済検査Tkを実行して救済検査結果TkRを出力する救済検査手段40と、第1検査結果T1R及び救済検査結果TkRに基づいて電子部品1に対する総合判定を行う総合判定手段50と、を備える。